

AC-Plasma에서의 Langmuir Probe를 이용한 전자온도와 이온밀도의 측정

문민욱, 박원배, 정세훈, 한용규, 손창길, 유나름, 이수범, 이해정, 임정은,
이준호, 송기백, 오필용, 정진만, 고병덕, 최은하
광운대학교 전자물리학과 PDP연구센터

Langmuir Probe를 이용해 AC-PDP에서의 전자온도와 이온밀도를 측정하였다. 실험에 사용한 패널은 유사 패널로서 1인치 알루미늄전극을 사용하였다. 이 위에 유전체와 MgO 보호막을 증착한 후 상판만을 이용하여 실험을 하였다. 실험에 사용한 Gas는 삼중가스로 He(70%)+Ne(26%)+Xe(4%)를 이용하였다. Langmuir Probe를 통해 들어온 I-V 곡선을 이용하여 플라즈마의 전자 온도를 측정하였고 또한 이를 바탕으로 이온 밀도를 관찰하였다.